

## ДИФРАКЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДЛОЖКАХ ИЗ $\text{LiNbO}_3$

*A. A. Адхамов, A. H. Шкляр, B. C. Бондаренко, L. M. Слуцкий,  
B. C. Орлов*

Методом рентгеновской съемки «на отражение» визуализирована поверхностная акустическая волна (ПАВ), распространяющаяся по подложке из ниобата лития. Микрофотометрированием рентгенограмм получены поперечные и продольные профили пучка ПАВ. Проведен качественный анализ амплитуд пучка ПАВ в зависимости от величины амплитуды сигнала. Обнаружено неравномерное возрастание амплитуды ПАВ на выходном преобразователе при прохождении по образцу ПАВ большой интенсивности.

Необходимость изучения ПАВ, распространяющихся в анизотропных пьезоэлектрических кристаллах, вызывается постоянным повышением требований к параметрам акустоэлектронных устройств: линий задержки, фильтров (полосовых, оптимальных, скатия), корреляторов и т. д. При этом наибольший интерес представляют попытки экспериментального наблюдения дифракции ПАВ. В основном такие исследования связаны с использованием лазерного [1, 2] и электрического [3] зондов. Электрическое зондирование позволяет измерять локальные электрические поля, связанные с волной, и, таким образом, получать амплитуды электрического потенциала поверхности волны.

Целью настоящей работы явилось исследование с помощью методов рентгеновской топографии дифракционных эффектов пучка ПАВ, распространяющихся с различной амплитудой по кристаллической подложке из  $\text{LiNbO}_3$ . Методы рентгеновской топографии были успешно применены при исследовании объемных волн [4-7]; область распространения ПАВ (при использовании съемки «на отражение») выделяется на рентгенотопограмме кристалла, образуя зону повышенного контраста; этот эффект, связанный с уменьшением экстинкции при наличии искажений в кристаллической решетке, может быть количественно оценен в рамках динамической теории рассеяния рентгеновских лучей [8-10].

По Като [9], интенсивность рентгеновских лучей, рассеянных решеткой кристалла, искажение которой задано вектором смещения  $u$ , равна

$$I = C_1 [(A + 4)^{1/2} E(k) - 2(A + 4)^{-1/2} K(k)], \quad (1)$$

где  $k = \left(\frac{A}{A + 4}\right)^{1/2}$ ,  $A = C_2 f^2$ ,  $K(k)$  — комплексные эллиптические функции 1-го и 2-го порядков соответственно;  $C_1$  и  $C_2$  — константы, связанные с данным типом деформации в кристалле;  $f$  — функция Като.

Для деформаций типа «чистый изгиб» или «чистое изменение межплоскостного расстояния» функцию  $f$  можно, как было показано в [10], представить в виде

$$f = \frac{2\pi}{\sin 2\Theta_B} [u_{1,22} \cos^2 \Theta_B - u_{1,11} \sin^2 \Theta_B] (\mathbf{g} \mathbf{u}), \quad (2)$$

где  $\mathbf{g}$  — вектор дифракции,  $\mathbf{u} = (u_1, 0, 0)$  — вектор смещения,  $\Theta_B$  — угол Брэгга,  $u_{1.22}$  и  $u_{1.11}$  — градиенты деформации типов «чистый изгиб» и чистое изменение межплоскостного расстояния соответственно.

Для колебаний сдвига по контуру кварцевой пластинки ДТ-среза было найдено, что [4]

$$\left. \begin{array}{l} J \cong C_1 \left( \frac{\pi}{2} \right) \left[ 1 + \frac{3}{16} f^2 \right] \text{ для малых смещений,} \\ J \cong C_1 \left( \frac{\pi}{2} \right) f \text{ для больших } f, u. \end{array} \right\} \quad (3)$$

Если изображение кристалла фиксируется на рентгеновской пленке, то аналогичные соотношения можно записать для плотностей покернения пленки (при  $D \leq 1$ ,  $D \propto J$  [11])

$$\left. \begin{array}{l} D \propto f^2 \text{ при малых } f, u, \\ D \propto f \text{ при больших } f, u. \end{array} \right\} \quad (4)$$

Таким образом, механические смещения, возбуждаемые в решетке кристалла при прохождении пучка ПАВ, можно характеризовать плотностью покернения рентгенотопограммы кристалла. Необходимо отметить, что величина механических смещений в пучке ПАВ однозначно не определяется степенью покернения рентгеновской топограммы кристалла и связь эта с учетом некоторых приближений [4] носит сложный характер. Надежно установлено, однако [4, 5], что интенсивность монотонно возрастает с увеличением искажения решетки.

При возбуждении ПАВ в кристалле возникают смещения, соответствующие основной и побочным модам, их гармоникам, а также отраженной ПАВ; в результате интегральная интенсивность  $J$  отражает сложное деформированное состояние поверхности кристалла.

## Методика эксперимента и экспериментальные результаты

Исследование поверхностных волн рентгенотопографическим методом возможно при условии использования съемки на отражение («по Брэггу»). Используя острофокусный источник, Шульц [12] изучал дефекты поверхности монокристаллов. В описываемом эксперименте для исследования ПАВ была применена схема съемки по Шульцу. Источником полихроматического излучения служила острофокусная (размер фокусного пятна —  $40 \times 40 \text{ мкм}$ ) рентгеновская трубка БСМ-1 (Мо), съемка производилась на аппарате «УРС-0.02» ( $V_a = 35 \text{ кВ}$ ,  $i_a = 0.35 \text{ мА}$ ). Поверхностная акустическая волна возбуждалась в широкополосном фильтре со средней частотой 35 МГц, конструктивно выполненном на подложке  $YZ$ -среза ниобата лития. Структурная схема исследований ПАВ в кристалле рентгенотопографическим методом дана на рис. 1.

В описываемом эксперименте (изображение фиксировалось на плоской пленке) наблюдается деформирование изображения на рентгенотопограмме [13]: отношение ширины к длине образца на рентгенотопограмме равно  $2 : 1$ , в исследуемом образце —  $1 : 2$ . Область распространения ПАВ в кристалле резко выделяется на общем фоне рефлекса рентгенотопограммы (рис. 2, б). Полученные рентгеновские топограммы кристаллов, в которых были возбуждены ПАВ (рис. 2), фотометрировались на микрофотометре ИФО-451; сечение светового пятна при фотометрировании равнялось  $0.3 \times 0.03 \text{ мм}^2$ , скорость записи микрофотограмм — 200 мм/мин, при масштабе записи  $2 : 1$ . Зона колебаний фотометрировалась в двух взаимно перпендикулярных направлениях для определения профилей пучка ПАВ, соответствующих ее амплитуде. Разрешение при фотометрировании вдоль оси пучка равнялось  $\lambda/3$ , перпендикулярно пучку —  $3.3\lambda$ .

Вдоль оси пучка было снято 12—13 микрофотограмм с интервалом 1 мм, поперек пучка — 8—9 микрофотограмм с интервалом 2 мм (рис. 3). В переводе на реальные размеры кристалла интервалы составили  $3\lambda$  и

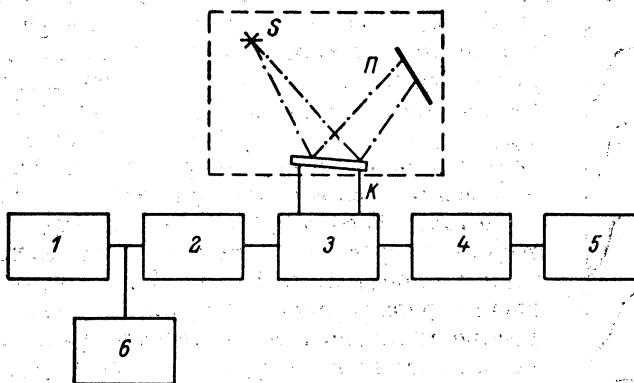


Рис. 1. Структурная схема исследования ПАВ в кристаллах методом рентгеновской топографии.

1 — генератор стандартных сигналов, 2 — усилитель, 3 — блок нейтрализации статической емкости ВШП, 4 — согласующая детекторная головка с выходным сопротивлением 75 Ом, 5 — вольтметр, 6 — частотомер, S — источник рентгеновских лучей, K — кристалл, П — рентгеновская пленка.

$.20\lambda$  соответственно. Учитывая принятые приближения, можно считать, что построенные проекции отображают усредненные во времени смещения кристаллической решетки в различных областях поверхности подложки. Увеличение электрического сигнала на входе фильтра приводит

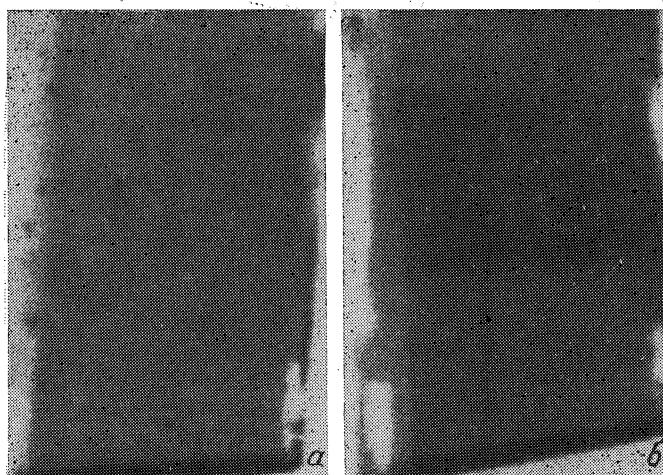


Рис. 2. Рентгеновские топограммы кристаллического фильтра на ПАВ ( $YZ$  — срез  $\text{LiNbO}_3$  плоскость (012)).

а — исходное состояние, б — возбуждение ПАВ.  $v=35$  МГц,  $U_{\text{вых}}=1.06$  В.

к возрастанию амплитуд смещений поверхности (рис. 4). При этом наблюдается линейная зависимость плотности почернений (амплитуд) от величины электрического сигнала практически для всех профилей пучка ПАВ в интервале  $U_{\text{вых}}=0 \div 0.8$  В. Исключение составляет кривая профиля № 6 (на границе центральной части звукопровода и выходных ВШП), нелинейность которой обусловлена, вероятно, дифракцией в области выходных ВШП. По мере увеличения  $U_{\text{вых}} (> 0.8$  В) линейность кривых почернения как функций  $U_{\text{вых}}$  нарушается и в дальнейшем наблюдается выравнивание

(насыщение) всех кривых почернения. (Абсолютная величина почернения ( $D - D_0$ ) рассчитывалась по графической характеристике фотометрического клина микрофотометра ИФО-451 с пределами измерения оптической плотности от 0 до 2.56 ед.). Аналогичная картина наблюдалась в исследований

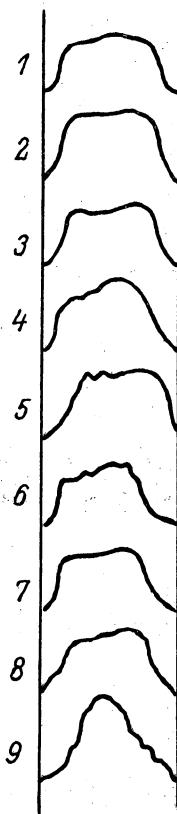


Рис. 3.

насывающих объемных волн [4, 5]: по мере увеличения деформации решетки кристалл становится «идеально несовершенным» и интегральная интенсивность стремится к постоянному пределу:  $J_{\max} = J_k$  ( $J_k$  — интенсивность, рассчитанная на основе кинематической теории рассеяния [8]), а также нарушается условие пропорциональности:  $i_c \propto u$  ( $i_c$  — пьезоток). Интерес, на наш взгляд, представляет эффект возрастания смещения на выходном ВШП (кривая профиля № 8, рис. 4). По-видимому, нарушение равномерного затухания амплитуды ПАВ, распространяющейся по пьезоэлектрической подложке со сложной структурой электродов, связано

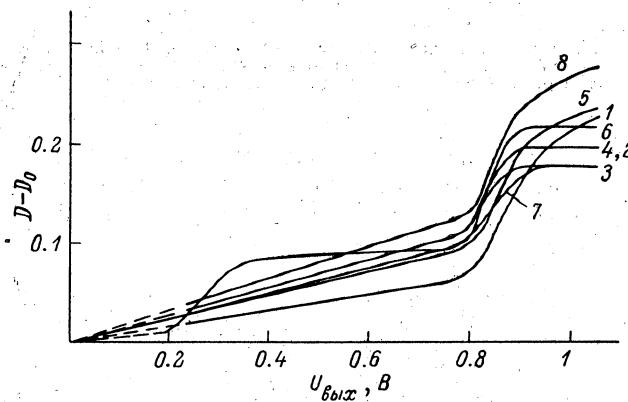


Рис. 4.

Рис. 3. Картина поперечных профилей почернения пучка ПАВ.

Микрофотометрирование поперек пучка велось в направлении от входного ВШП к выходному (кривые на рисунке — сверху вниз); при этом профили №№ 1—4 относятся к входному ВШП, №№ 5—6 — к центральной части звукопровода, №№ 7—9 — к выходному ВШП.  $U_{\text{вых}} = 0.9$  В.

Рис. 4. График зависимости плотности почернения  $D = D - D_0$  рентгенотопограммы подложки фильтра (поперечные профили пучка ПАВ,  $D_0$  — оптическая плотность вуали) от амплитуды электрического сигнала.

Цифрами обозначены номера профилей.

с суммированием амплитуд от сигналов чередующихся штырей преобразователей. Авторы [2] отмечают, что в ряде случаев принятый сигнал по существу увеличивается дифракцией.

Описанная в статье методика может быть использована для изучения распределения амплитуд смещений ПАВ на поверхности подложки, обусловленных дифракцией, отражением, побочными модами колебаний и т. д. Методика позволяет исследовать влияние неоднородностей в виде преобразователей, экранов и других элементов на параметры распространяющихся ПАВ с целью совершенствования конструкции и технологии изготовления акустоэлектронных устройств обработки сигналов.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Э. Дж. Слободник — мл. ТИИЭР, 64, 10, 1976.
- [2] R. Mitchell, R. Stevens. Wave Electronics, 1, 204, 1974/75.
- [3] P. J. Hagon, K. M. Lakin. US. Symp. Proc. JEEE Cat. N 74 СНО, 896—1 SU, p. 341, 1974.

- [4] К. Нагита. J. Appl. Phys., 38, 3312, 1967.
- [5] У. Спенсер. В кн.: Физическая акустика, т. 5, с. 134—191. М., Мир, 1973.
- [6] Б. К. Казуров и др. В сб.: Аппаратура и методы рентгеноносского анализа, вып. 3, с. 209. Л., 1968.
- [7] В. Шин, С. Ф. Травкина, В. Н. Стасевич. Электронная техника. сер. 9, вып. 6, 10, 1969.
- [8] Р. Джеймс. Оптические принципы дифракции рентгеноносских лучей. М., ИЛ, 1950.
- [9] Н. Като. J. Phys. Soc. Japan, 19, 971, 1964.
- [10] У. Бонсе. Zs. Phys., 177, 85, 1964.
- [11] К. Миз, Т. Джеймс. Теория фотографического процесса. Л., Химия, 1973.
- [12] Л. Г. Schulz. Trans. AIME, 200, 1082, 1954.
- [13] Л. И. Мелешко, Е. И. Соснина. В сб.: Несовершенства кристаллического строения, 34, с. 92. Киев, Наукова думка, 1971.

Физико-технический институт  
им. С. У. Умарова АН ТССР  
Душанбе

Поступило в Редакцию  
24 апреля 1980 г.  
В окончательной редакции  
19 декабря 1980 г.